

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223871.1401.13.50.8.9 Research Article

Simulation and Analysis of the Effect of Parameters on the Spectral Response of Electric Field Enhancement Factor in the Proposed AFM-TERS System

Mohsen Katebi Jahromi, Ph.D. Student, Rahim Ghayour, Professor, Zahra Adelpour, Assistant Professor

Department of Electrical Engineering- Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran mohsen.katebi@iausafashahr.ac.ir, rghayour@shirazu.ac.ir, adelpour@aut.ac.ir

Abstract

One of the most important advances in Raman spectroscopy in recent years has been its integration with scanning probe microscopes (SPM), especially atomic force microscopes (AFM). Currently, AFM is recognized as one of the best imaging methods for studying the distribution of heterogeneous surface in nanoscale dimensions. Scientists are now focused on obtaining more enhancement factor of electric field, to the extent that detection and mapping of only one molecule has become possible with this method. Therefore, spatial resolution is being improved in detecting sub-molecule levels. In this paper, using the finite difference time domain (FDTD) calculation method, the effect of changing the parameters of the probe such as cone angle, tip radius and its material on the electric field intensity near the apex of the probe is investigated. In addition, the effect of polarization of light on the increase of electric field has been analyzed. The simulation results obtained for different cone angles show that the cone angle of 30 degree creates the highest amount of electric field enhancement factor at the tip apex. Furthermore, the use of laser source with radially polarized light and the use of substrate are very effective factors on improving the electric field enhancement factor. Finally, the maximum value of electric field enhancement factor of the proposed configuration is 3.2×10^4 , where this value has been improved significantly comparing to the results reported in the previous papers published in this field.

Keywords: atomic force microscopy, localized surface plasmon resonance (LSPR), tip enhanced Raman spectroscopy (TERS), tip apex

Received: 15 July 2021 Revised: 22 August 2021 Accepted: 21 September 2021

Corresponding Author: Prof. Rahim Ghayour

Citation: M. Katebi Jahromi, R. Ghayour, Z. Adelpour, "Simulation and analysis of the effect of parameters on the spectral response of electric field enhancement factor in the proposed AFM-TERS system", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, vol. 13, no. 50, pp. 123-132, September 2022 (in Persian).

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23223871.1401.13.50.8.9 مقاله پژوهشی

شبیهسازی و تحلیل پارامترهای موثر بر پاسخ طیفی فاکتورتقویت میدان الکتریکی در یک سیستم AFM-TERS پیشنهادی

محسن کاتبی جهرمی، دانشجوی دکتری، رحیم غیور، استاد، زهرا عادل پور، استادیار

گروه مهندسی برق- واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران mohsen.katebi@iausafashahr.ac.ir, rghayour@shirazu.ac.ir, adelpour@aut.ac.ir

چکیده: یکی از پیشرفتهای مهم سالهای اخیر در دستگاه رامان، تلفیق آن با میکروسکوپ پروب روبشی (SPM) بهخصوص میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) بوده است. میکروسکوپ نیروی اتمی در حال حاضر بهعنوان یکی از بهترین روشهای تصویربرداری برای مطالعه توزیع ناهمگون سطح در ابعاد نانو شناخته میشود. در سالهای اخیر دانشمندان بر روی بهدست آوردن فاکتور تقویت میدان الکتریکی بیشتر متمرکز شدهاند تا آنجا که آشکارسازی و نقشهبرداری از یک مولکول تنها با این روش امکانپذیر شده است. در نتیجه رزولوشن فضایی جهت تشخیص در مقیاس زیر مولکول در حال بهبود است. در این مقاله با استفاده از روش محاسباتی تفاضلی محدود در حوزه زمان (DTD) اثر تغییر پارامترهای پروب مثل زاویه مخروط، شعاع تیپ و جنس آن بر میزان شدت میدان الکتریکی نزدیک به نوک پروب مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت پس از یافتن بهترین ساختار تیپ و نوع پلاریزاسیون نور تابشی، اثر استفاده از زیرلایه در سیستم طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی (PTS) بررسی شده زاویه مخروط ۳۰ درجه بیشترین میزان تقویت میدان الکتریکی در نوک تیپ را ایجاد می کند. همچنین به کار بردن منبع نور تابشی با پلاریزاسیون داور ایشی، اثر استفاده از زیرلایه در سیستم طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی (بودن منبع نور تابشی با پلاریزاسیون دور ایشی، اثر استفاده از زیرلایه در سیستم طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی (بودن پیشنهادی بررسی شده زاویه مخروط ۳۰ درجه بیشترین میزان تقویت میدان الکتریکی در نوک تیپ را ایجاد می کند. همچنین به کار بردن منبع نور تابشی با پلاریزاسیون دایرهای و استفاده از زیرلایه از عوامل بسیار موثر جهت بهبود فاکتور تقویت میدان الکتریکی هستند. در انتها برای ساختار طراحی شده ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی ۲۰۱۴ یو می اکتور تقویت میدان اکتریکی با به برای ساختار در انتها برای ساختار طراحی شده مراحی این می مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی را در برای می در دان الکتریکی ترد را به بود آمده است، که این مقدار در مقایسه با نتایج گزارش شده در مطالعات قبلی بهبود قابل توجه داشته است.

کلمات کلیدی: تشدید پلاسمون های سطحی محلی، طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی، نوک تیپ، میکروسکوپ نیروی اتمی

تاریخ ارسال مقاله: ۱۴۰۰/۴/۲۴ تاریخ بازنگری مقاله: ۱۴۰۰/۵/۳۱ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۴۰۰/۶/۳۰

نام نویسندهی مسئول: دکتر رحیم غیور **نشانی نویسندهی مسئول:** کیلومتر ۵ شهر صدرا- پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

۱– مقدمه

عموما در اثر برهمکنش تابش الکترومغناطیس با ماده، پدیدههای مختلفی می تواند ایجاد شود که شامل جذب، انتقال، بازتاب و پراکندگی است. هر یک از این پدیدهها می تواند اطلاعات ضروری درباره اثرات شیمیایی در ماده را تامین کند [۱]. طیف نمایی رامان یک روش قدر تمند است که می تواند اطلاعات شیمیای قابل توجهی در مورد مولکول های هدف ارائه دهد اما از آنجا که سیگنال های رامان ضعیف ه ستند لذا تمایل به افزایش سیگنال های رامان نیازمند رویکردی جدید و نو ا ست [۲]. یکی از پیشرفتهای اخ ـ یر تلفیق می ـ کروسکوپ نیروی اتمی¹ (AFM) همراه با طیف سنجی رامان در یک دستگاه است که زمینه ای منا سب برای تحقیقات جدید ا ست [۳]. با اختراع میکرو سکوپ پروب روبشی⁷ (MSN) در اواخر قرن بیستم علاوه بر مواد رسانا، امکان تصویربرداری از نمونه بدون نیاز به خلاء فراهم گردید و نقطه عطفی در نانوسکوپی اتفاق افتاد. میکرو سکوپهای نیروی اتمی، د سته ای از میکرو سکوپهای پروب روبشی ۳ (ASN) در اواخر قرن بیستم علاوه بر غیر خلاء، می توانند از نمونه های زیستی و غیررسانا نیز تصویربرداری کرده و همچنین در تعیین خواص مختلف نمونه ها، آنالیزهای کاربردی در اختیار محققین قرار دهند [۴]. در حقیقت نتایج به دست آمده تو سط میکرو سکوپ نیروی اتمی و رامان میکمل هم هستند [۵]. اصل ساختار میکروسکوپ نیروی اتمی همراه با طیف سنجی رامان تویی آواص مختلف نمونه ها، میمل هم هستند [۵]. اصل ساختار میکروسکوپ نیروی اتمی همراه با طیف سنجی رامان تقویت شده سوزنی^۳ (AFM-TERS) در شکل (۱) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود یک سوزن فلزی MSN در مرکز کانون یک لیزر واقع شده در شکل (۱) نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می شود یک سوزن فلزی MSN در مرکز کانون یک لیزر واقع شده

زمانی که تیپ میکرو سکوپ نیروی اتمی با یک منبع خارجی مورد تابش قرار می گیرد شدت پراکندگی رامان مولکول هدف در نزدیکی تیپ تا حد زیادی افزایش می یابد که مربوط به تشدید پلاسمونهای سطحی محلی^۴ (LSPR)، اثر میله روشنایی^۵ و تشدید حالت شکاف⁹است. بنابراین تیپ نقش اساسی در طیف سنجی رامان تقویت شده سوزنی ایفا می کند [۷]. طیف نمایی رامان تقویت شده سوزنی می تواند رزولو شن فضایی در اسکیل چند نانومتر فراهم کند [۸]. در طول پانزده سال گذشته این روش برای مطالعه مسائل بیولوژیکی [۹]، فتوولتاییک [۱۰]، نیمه هادی [۱۱]، نانو تیوب کربنی [۱۲]، گرافن [۱۳] و تشخیص مولکولهای تنها [۱۴] استفاده شده است.

اگر چه روشهای میکرو سکوپی فلور سانس نیز میتواند برای تصویربرداری از نمونهها تحت محدودیت انکسار با رزولو شن بالا استفاده شود اما وجود برچسب فلورسنت مانع از مشاهده نمونه در حالت طبیعی میشود این در حالی است که تکنیک طیفنمایی رامان تقویتشده سوزنی یک روش بدون برچسب^۷ است و میتواند برای بررسی و مطالعه ترکیبات شیمیایی و رفتار مولکولها بخصوص در نمونههای بیولوژیکی بهطور مستقیم استفاده شود [۱۵،۱۶]. طلا و نقره دو تا از بهترین مادهها برای ساخت تیپهای طیفنمایی رامان تقویتشده سروزنی هستند که مربوط به چگالی الکترونهای آزاد بالا و اثر تشدید پلاسمونهای سطحی محلی قوی در ناحیه مرئی و مادن قرمز نزدیک است [۵،۱۷].

در این مقاله با استفاده ازروش تفاضلی محدود در حوزه زمان در حالت سهبعدی^۸ (3D-FDTD) که در آن از معادلات دیفرانسیلی محدود برای حل معادلات ماکسول در محدوده محاسباتی محدود استفاده میشود، فاکتور تقویت میدان الکتریکی در نوک یک تیپ نقره و طلا بهدست آمده است. شبیهسازی برای زاویههای مخروط^۹ مختلف و شعاعهای تیپ^{۱۰} متفاوت تحت تابش نور با پلاریزاسیونهای خطی و دایرهای^{۱۱} برای یافتن بهترین ساختار با بیشترین میزان تقویت میدان الکتریکی در نوک تیپ انجام شده است. جنبههای نوآوری در مطالعه انجام شده دراین مقاله بهصورت زیر است:

۱- در این مقاله از منبع نور با پلایرازسیون دایرهای با پیکربندی تابش از کنار جهت نور تابشی به نوک تیپ استفاده شده است. نتایج بهدست آمده در این مقاله در مقایسه با مطالعات انجام شده در این زمینه که عمدتا از نور با پلایرازسیون خطی با پیکربندی تابش از انتهای تیپ استفاده کردهاند، بهبود قابل توجه داشته است.

۲- در این مقاله فاصله نوک تیپ از زیرلایه^{۱۲} برای داشتن بیشترین میزان فاکتور تقویت میدان الکتریکی بهینه شده است و با استفاده از بخش بهینهسازی در نرمافزار لومریکال فاصله بهینه ۲/۶۶ نانومتر بهدست آمده است در حالی که در مقالات چاپ شده در این زمینه [۸،۱۸] این فاصله بهصورت فرضی در نظر گرفته شده است و تاثیر فاصله نوک تیپ از زیر لایه بر روی شدت میدان الکتریکی بررسی نشده است.



شکل (۱): شماتیک نشان دهنده اصل میکروسکوپ نیروی اتمی-طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی [۶] Figure (1): The schematic of AFM-TERS principle [6]



شکل (۲): هندسه پیکربندی تیپ و زیرلایه[۱۹] Figure (2): Schematic diagram of the metal tip and substrate geometry [19]

۳- در این مقاله برای نخستین بار با استفاده از بررسی تاثیر پارمترهای هندسی تیپ و جنس زیرلایه و تیپ مورد استفاده بر میزان فاکتور تقویت میدان الکتریکی بهصورت همگام، بهبود قابل توجهی بر میزان فاکتور تقویت میدان الکتریکی نسبت به مقالات چاپ شده [۱۹،۲۰] در این زمینه حاصل شده است.

ساختار مقاله به این شرح است. پس از بیان موضوع و اهمیت آن، در بخش دوم به شرایط شبیهسازی و روش طراحی اشاره می گردد. در بخش سوم با استفاده از تجزیه و تحلیل نتایج شبیهسازیهای انجام شده اثر پارامترهای مختلف بر روی ماکزیمم مفدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی بررسی شده است و نتایج ساختار پیشنهادی در این مقاله با نتایج مقالات چاپ شده قبلی مقایسه شده است. در نهایت در بخش چهارم نتیجه گیری مقاله بیان شده است.

۲- شرایط شبیهسازی و روش طراحی

روش تفاضلی محدود در حوزه زمان (FDTD) یک روش موثر به دلیل قابلیت آن برای بررسی هر هندسه دلخواه سه بعدی (3D) از جمله تیپ فلزی، زیر لایه فلزی و مدلهای مشابه دیگر است [۲۱]. در این روش نیاز است که کل محدوده محاسباتی به المانهای حجمی یا سلولها تقسیم یا تفکیک شوند [۲۲]. در بسیاری از موارد روش تفاضلی محدود در حوزه زمان بر اساس فرمول شناخته شده علال است [۲۲]. در بسیاری از موارد روش تفاضلی محدود در حوزه زمان بر اساس فرمول شناخته شده علال است [۲۲]. در معادلات ماک سول را در فرم دیفرانسیل به سلول علال کرد، مرمول شناخته شده علال است [۳۵]. برای اینکه بتوان معادلات ماک سول را در فرم دیفرانسیل به سلول علال کرد، مشات زمانی و مکانی از عبارات تفاضلی محدود در حوزه زمان بر اساس مشیتقات زمانی و مکانی از عبارات تفاضلی محدود استفاده می کنند که معادلات تفاضلی محدود در حوزه زمان را نتیجه میدهند [۳۴]. روش تفاضلی محدود در حوزه زمان نتایج را در متغیرهای میدانی ع و H در تمامی نقاط در حوزه گسسته و در هر نقطه زمانی ارائه می دهد [۳۵].

شکل (۲) شماتیک هند سه پیکربندی تیپ فلزی و زیرلایه که دراین مطالعه ا ستفاده شده ا ست را نشان میدهد. تیپ فلزی بهعنوان یک مخروط وارونه که به یک نیمکره ختم می شود مدل شده ا ست. D قطر بیس، L ارتفاع مخروط، α زاویه مخروط، d فاصله نوک تیپ از زیر لایه و θ زوایه نور تابشی منبع لیزر است که بهصورت یک موج الکترومنغاطیس مسطح است.

در این مقاله مانند مطالعه انجام شده در مرجع [۱۹] از ساختار تابش از کنار که مناسبترین انتخاب برای آنالیز نمونههای غیرشفاف یا نمونههایی که بر روی زیرلایه غیرشفاف در یک سیستم طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی (TERS) قرار گرفتهاند، استفاده شده است. همچنین این ساختار روشی آسانتر در مقایسه با ساختار تابش از پایین برای تنظیم پلاریزاسیون پرتو نور برخوردی در راستای محور تیپ است که باعث ماکزیمم شدن فاکتور تقویت میدان میشود [۱۹]. در این مقاله از یک منتبع نور موج مسطح از نوع میدان کل- میدان پراکنده^{۱۳} (TFSF) استفاده شده است که از کوپلینگ احتمالی با مرزهای ناحیه شبیه سازی جلوگیری نماید. منتبع نور میدان کل- میدان پراکنده یک نوع خاص از موج مسطح است که ناحیه محاسباتی را به دو ناحیه مجازا تقسیم میکند. ناحیه اول شامل میدان کل میدان کل میدان پراکنده یک نوع خاص از موج مسطح است که ناحیه محاسباتی را به دو ناحیه مجازی می میدان پراکنده شده است که مجموع میدان برخوردی و میدان پراکنده شده است و ناحیه محاسباتی را به دو ناحیه مجزا تقسیم میکند. ناحیه اول شامل میدان کل است که مجموع میدان برخوردی و میدان پراکنده شده است و ناحیه دوم شامل میدان پراکنده است. پرتو لیزر یک موج مسطح با میدان الکتریکی با دامنه ۱ ولت بر متر است. برای تمام شبیه سازی ها شرایط مرزی لایه کاملا جاذب¹⁴ (PML) برای تمام مرزها استفاده شده است. سایز TESE در رنج ۵/۰ تا ۱ ناحیه دوم شامل میدان پراکنده است. و تو لیزر یک موج مسطح با میدان الکتریکی با دامنه ۱ ولت بر متر است. برای تمام شبیه سازی ها شرایط مرزی لایه کاملا جاذب¹⁴ (PML) برای تمام مرزها استفاده شده است. سایز TESE در رنج ۵/۰ تا ۱ ناومتر در نظر گرفته شده است. روش TESE با مثال زوع غیر - یکنواخت^{۵۵} برای بهبود دقت مدل سازی و برای کاهش منابع محاسباتی اعمال میشود. ثابت های نوری طلا و نقره از مرجع [۲۶] بهدست آمده است. فاکتور تقویت میدان الکتریکی در نوک محاسباتی اعمال میشود. ثابتهای نوری طلا و نقره از مرجع [۲۶] بهدست آمده است. فاکتور تقویت میدان الکتریکی در نوک محاسباتی اعمال میشود. ثابتهای نوری با پلاریزاسیون خطی و دایرهای در رنج طول موج ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ نانومتر با توجه به معادله زیر محاسبه شده است (۲۸۱

$$M^{2} = EF = \frac{|E_{loc}|^{2}}{|E_{o}|^{2}}$$
(1)

در معادله بالا E_{loc} میدان الکتریکی موضعی در نوک تیپ و E_o میدان الکتریکی تابشــی اســت. مقدار E_{loc} از جمع میدانهای الکتریکی در راستای y ax و z با توجه به معادله زیر بهدست میآید:

$$E_{z} = 2iA0 \int_{0}^{\alpha} P(\theta) \cos^{1/2} \theta \sin^{2} \theta J_{0}(K_{r} \sin \theta) \exp(ik_{z} \cos \theta) d\theta$$
 (7)

$$E_{r} = A0 \int_{0}^{u} P(\theta) \cos^{1/2} \theta \sin(2\theta) J_{1}(K_{r} \sin \theta) \exp(ik_{z} \cos \theta) d\theta$$
(*)

$$K = \frac{2\pi}{\lambda}$$
 (Δ)

در معادله بالا A₀ یک ثابت، k بردار موج، α ماکزیمم زاویه تمرکز و J₀ و J₀ و J₀ به ترتیب توابع بسل نوع اول از مرتبه های صفر و یک هستند. (P(θ) تابع مردمک یک پرتو بسل گوسی است که به صورت زیر تعریف می شود [۲۹]: P(θ) = exp $\left[-\beta^{2}\left(\frac{\sin\theta}{2}\right)^{2}\right]$ J $\left(\frac{2\beta\sin\theta}{2}\right)$

نور با پلاریزاسیون دایرهای درون ناحیه شبیهسازی ایجاد میشود.

۳- نتایج و بحث

در این قسـمت اثر تغییرات زاوریه مخروط، شـعاع نوک تیپ، نور تابشـی با پلاریزاسـیون دایرهای و اثر زیرلایه بر روی ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی ارائه شده است.

۳-۱- بررسی اثر تغییرات زاویه مخروط

در ابتدا شبیهسازی برای تیپ طلا و نقره با شعاع تیپ ۱۰ نانومتر بدون زیرلایه برای زاویههای مخروط ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درجه با نـور پـلاریزه شده خـطی عـمود بر مـحور تیپ (θ برابر ۹۰ درجه) انجام شده اسـت. ابـعاد تیـپ استـفاده شـده بهصورت زیر در نرم افزار لومریکال در نظر گرفته شده است [۸،۱۸]: $\begin{cases} \text{cladding radius}\left(\frac{D}{2}\right) = 800 \text{ nm} \\ \text{z span}\left(L\right) = 3000 \text{ nm} \end{cases}$ (Y)

در رابطه بالا، D قطر بیس و L ارتفاع مخروط است که در شکل (۲) نیز نشان داده شده است. با توجه به ابعاد انتخاب شده جهت تیپ مورد نظر که منطبق با حالت واقعی نیز است در صورتی که زاویه مخروط کمتر از ۵ درجه و بیشتر از ۳۰ درجه انتخاب شود ساختار هندسی تیپ مورد نظر از حالت مخروطی خارج می شود و در محدوده محاسباتی نرمافزار قرار نمی گیرد. همچنین در افزایش زاویه مخروط اثر نامطلوبی که این افزایش بر میزان رزولوشن فضایی سیستم می گذارد نیز در نظر گرفته شده است [۸]. در شکل (۳) پاسخ طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ طلا نشان داده شده است. همان طور که نشان داده شده با افزایش زاویه مخروط از ۵ درجه به ۳۰ درجه ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی افزایش یافته است. در شکل (۴) توزيع ميدان الكتريكي در اطراف نوك تيپ طلا با زاويه مخروط ۳۰ درجه كه با توجه به شكل (۳) بيشترين ميزان فاكتور تقويت میدان الکتریکی را ایجاد میکند، نشان داده شده است. همانطور که مشخص است میدان الکتریکی در نوک تیپ نسبت به اطراف آن قوىتر بوده كه باعث ايجاد نقطه داغ در نوك تيپ مىشود و با دور شدن از نوك تيپ شدت ميدان الكتريكى كاهش مییابد. در شکل (۵) پاسخ طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ نقره نشان داده شده است. همان طور که دیده می شود برای تیپ نقره نیز با افزایش زاویه مخروط ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی روند صعودی دارد. در شکل (۶) توزیع میدان الکتریکی در اطراف نوک تیپ نقره با زاویه مخروط ۳۰ درجه که با توجه به شکل (۵) بیشترین میزان فاکتور تقویت میدان الکتریکی را ایجاد می کند، نشان داده شده است. با توجه به نتایج شکلهای (۳) و (۵) بیشترین مقدار ضریب تقویت میدان الکتریکی برای تیپهای طلا و نقره با زوایای مخروط متفاوت در جدول (۱) خلاصه شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، شدت میدان الکتریکی در نوک تیپ با افزایش زاویه مخروط افزایش می یابد. همچنین ماکزیمم مقدار شدت میدان الکتریکی در نوک تیپ نقره نسبت به تیپ طلا افزایش بیشتری دارد. تقویت میدان الکتریکی موضعی در نوک تیپ زمانی بسیار زیاد خواهد بود که طول موج پلاسمونهای سطحی محلی (LSP) با طول موج لیزر تحریک یکسان باشد. طول موج پلاسمونهای سطحی محلی برای تیپ در یک سیستم طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی میتواند با تغییر جنس تیپ، ساختار تیپ و پلایرازسیون نور تابشی و پیکربندی آن تغییر کند تا با طول موج لیزر منطبق شود.

با این تنظیمات حالت رزونانس بهوجود می آید که در این شرایط شدت میدان الکتریکی مشاهده شده در نوک تیپ چندین مرتبه بالاتر از حالتی است که شرایط رزونانس نداشته باشد [۵،۷]. با توجه به توضیحات بالا اگرچه رزونانس پلاسمونهای سطحی محلی برای تیپ طلا و نقره در محدوده طول موج مرئی لیزر تحریک ایجاد می شود اما همان طور که در شکلهای (۳) و (۵) نیز مشخص است طول موج رزونانس برای تیپ طلا ۶۹۸/۶ نانومتر و برای تیپ نقره ۵۱۰/۷ نانومتر است. همچنین همان طور که نتایج جدول (۱) نشان می دهد ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ نقره بیشتر از تیپ طلا است که دلیل آن رزونانس پلاسمونهای سطحی محلی قوی تر جهت تیپ نقره در ساختار اتخاب شده در مقاله جهت شبیه سازی است.



شکل (۳): پاسخ طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ طلا در زاویه های مخروط ۵، ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درجه Figure (3): Spectral responses of the electric field enhancement factor for the gold tip of cone angles of 5°, 10°, 20° and 30°







شکل (۵): پاسخ طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ نقره در زاویههای مخروط ۲۰،۱۰،۵ و۳۰ درجه Figure (5): Spectral responses of the electric field enhancement factor for the silver tip of cone angles of 5°, 10°, 20° and 30°





Table (1): The largest amounts of electric field enhancement factors for the gold and silver tips at different cone angles جدول (1): بيشترين مقدار فاكتور تقويت ميدان الكتريكي براى تيپ طلا و نقره با زاويه هاى مخروط متفاوت

جنس تيپ	زاویه مخروط (درجه)	ماكزيمم مقدار فاكتور تقويت ميدان الكتريكي		
طلا	۵	۱/• ۲× ۱ • ^۳		
	۱.	$1/\Delta \cdot \times 1 \cdot r$		
	۲.	۳/۰ ۸× ۱ ۰ ۲		
	٣٠	$\Delta/1$ $\lambda \times 1 \cdot r$		
نقره	۵	۱ <i>/۶</i> ۳×۱۰ ^۳		
	١.	۲/۵۵×۱۰ ^۳		
	۲.	۴/۴۵×۱۰ ^۳		
	٣٠	٩/۶٠×١٠		

۲-۲- بررسی اثر تغیرات شعاع نوک تیپ

در این بخش شبیه سازی برای تیپ طلا و نقره با زاویه مخروط ۳۰ درجه بدون زیرلایه برای شعاع های تیپ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ نانومتر با نور پلاریزه شده خطی عمود بر محور تیپ (θ برابر ۹۰ درجه) انجام شده است. کمترین شعاع تیپ به دلیل در نظر گرفتن محدودیت های ساخت ۱۰ نانومتر و بیشترین شعاع تیپ براساس مرجع [۸] برابر ۲۰ نانومتر در نظر گرفته شده است. در شکل های (۷) و (۸) پاسخهای طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ طلا و نقره نشان داده شده است. همان طور که در شکل ها مشخص است با افزایش شعاع تیپ از ۱۰ نانومتر به ۲۰ نانومتر ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی کاهش یافته است.

۳-۳- بررسی اثر نور تابشی با پلاریزاسیون دایرهای

با توجه به نتایج بخش قبل در این قسمت از تیپ طلا و نقره با زاویه مخروط ۳۰ درجه و شعاع تیپ ۱۰ نانومتر جهت شبیهسازی استفاده شده است. در شکل (۹) پاسخ طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ طلا و نقره تحت تابش نور با پلاریزاسیون دایرهای نشان داده شده است. با توجه به نتایج خلاصه شده در جدول (۱) ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ طلا و نقره تحت تابش نور با پلاریزاسیون خطی به ترتیب ۱۰۴×۸۱۸ و ۱۰۴×۶/۰ در طول موج رزونانس است، حال اگر تیپ مورد نظر تحت تابش نور با پلاریزاسیون خطی به ترتیب ۱۰۴×۸۱۸ و ۱۰۴×۲/۰ و ۱۰۲×۱۶۰ در طول موج رزونانس است، حال اگر مقدار فاکتور تقویت میدان الکتـریکی برای تیـپ طلا و نقره به ترتیب ۱۰۴×۸۱۸ و ۱۰۲×۲/۰ و ۱۰۶×۲۰۶ در طول موج رزونانس است، حال اگر می مورد نظر تحت تابش نور با پلاریزاسیون دایره ای تحریک شود همان طور که در شکل (۹) نشان داده شده است ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتـریکی برای تیـپ طلا و نقره به ترتیب ۱۰۴×۲/۲ و ۱۰۴×۲/۱ است، بنابراین استفاده از نور با پلاریزاسیون دایره ای به جای نور با پلاریزاسیون خطی باعث افزایش قابل توجه در ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی میشود.

۳-۴- بررسی اثر زیرلایه بر روی ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی

با توجه به نتایج بهدست آمده در بخشهای قبلی در این قسمت از یک تیپ نقره با زاویه مخروط ۳۰ درجه تحت تابش نور با پلاریزاسیون دایرهای که بیشترین میزان شدت میدان الکتریکی را ایجاد می کند، همراه با زیرلایههایی از جنس طلا، نقره و سیلیکا باضخامت ۵۰ نانومتر مطابق شکل (۲) استفاده شده است. فاصله نوک تیپ از زیر لایه با استفاده از بخش بهینهسازی در نرمافزار لومریکال چنان انتخاب شده است که بیشترین میزان شدت میدان الکتریکی در نانو گپ بین زیرلایه و نوک تیپ ایجاد شود. در شکل (۱۰) پاسخهای فرکانسی فاکتور تقویت میدان الکتریکی در نانوگپ بین تیپ نقره و زیرلایههای طلا، نقره و سیلیکا در حالت بهینه نشان داده شده است. با توجه به شکل (۱۰) بیشترین مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی در نانوگپ بین تیپ نقره و زیرلایههای طلا، نقره و سیلیکا در و زیرلایه طلا در شـرایط بهینه ^۴۰۱×۲/۲ حاصل میشود در حالی که همین مقدار در حالتی که از زیرلایه نقره استفاده می شود از زیرلایه استفاده نشده است. ۲۰



شکل (۷): پاسخ طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ طلا در شعاعهای تیپ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ نانومتر Figure (7): Spectral responses of the electric field enhancement factor for the gold tip for tip radiuses of 10 nm, 15 nm and 20 nm



شکل (۸): پاسخ طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ نقره در شعاعهای تیپ ۱۰، ۱۵ و ۲۰ نانومتر Figure (8): Spectral responses of the electric field enhancement factor for the silver tip for tip radiuses of 10 nm, 15 nm and 20 nm



شکل (۹): پاسخهای طیفی فاکتور تقویت میدان الکتریکی برای تیپ طلا و نقره در زاویه مخروط ۳۰ درجه تحت تابش نور با پلاریزاسیون دایرهای

Figure (9): Spectral responses of enhancement factors for the gold and silver tips with cone angles of 30° under radially polarized light



شکل (۱۰): پاسخ فرکانسی فاکتور تقویت میدان الکتریکی در نانو گپ بین تیپ نقره و زیرلایههای طلا ، نقره و سیلیکا در حالت بهینه Figure (10): Spectral responses of the enhancement factor within the nanogap between the silver tip and gold, silver and silica substrate in the optimal conditions

Table (2): Comparison of the results obtained in the published papers with the outcome of the method used in this article جدول (۲): مقایسه نتایج بهدست آمده در مقالات چاپ شده با نتیجه روش استفاده شده در این مقاله

منابع	[٨]	[16]	[٢+]	اين مقاله
ماكزيمم مقدار فاكتور تقويت ميدان الكتريكي	1/10×1.*	۱/۵×۱۰ ^۴	۲/۸×۱۰ ^۴	٣/٢×١• ^۴

بنابراین استفاده از زیرلایه با توجه به کوپلینگ خازنی بین دو فلز به دلیل ایجاد نقطه داغ در نانوگپ بین تیپ و زیرلایه، فاکتور تقویت میدان الکتریکی را به دلیل تشدید مد- شکاف افزایش میدهد [۳۰] و وجود زیرلایه باعث بهبود عملکرد سیستم میکروسکوپ نیروی اتمی- طیف سنجی رامان تقویت شده سوزنی در شناسایی مواد می شود. مقایسه نتایج به دست آمده در این مقاله با نتایج گزارش شده در مقالات چاپ شده قبلی در جدول (۲) نشان داده شده است. قابل توجه است که شرایط شبیه سازی در مقالات ذکر شده کاملا مشابه با شرایط در نظر گرفته شده در این مقاله است و در آنها نیز از روش تفاضلی محدود در حوزه زمان برای شبیه سازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که طراحی و بهینه سازی انجام شده در این مقاله ماکزیمم مقدار فاکتور تقویت میدان الکتریکی را نسبت به مطالعات انجام شده در این زمینه به شکل موثری بهبود داده است.

۴– نتیجه گیری

در این مقاله با استفاده از روش تفاضلی محدود در حوزه زمان تاثیر پارامترهای موثر بر شدت میدان الکتریکی در نوک تیپ مانند زاویه مخروط تیپ، شعاع تیپ و جنس آن در جهت بهینهسازی سیستم میکروسکوپ نیروی اتمی همراه با طیفسنجی رامان تقویت شده سوزنی مورد بررسی قرار گرفت، با توجه به نتایج بهدست آمده، برای تیپ نقره با زاویه مخروط ۳۰ درجه بیشترین میزان شدت میدان الکتریکی در نوک تیپ ایجاد میشود. نتایج بهدست آمده در مقاله نشان میدهند که استفاده از منبع نور با پلاریزاسیون دایرهای بهجای تابش نور با پلاریزاسیون خطی، همچنین استفاده از زیرلایه با فاصله بهینه نسبت به نوک تیپ باعث تقویت بیشتر میدان الکتریکی در نانو گپ بین تیپ نقره و زیرلایه میشود، بهطوری که با توجه به سیستم پیشنهادی در این مقاله امکان شناسایی و تشخصیص مولکول نمونه با دقت بسیار بالا قابل دسترس است. در نهایت امیدواریم که نتایج بهدست آمده در مقاله قادر باشد در ساخت تیپ پلاسمونیک با عملکرد مناسب کمک کند.

References

مراجع

- M. Schmitt, J. Popp, "Raman spectroscopy at the beginning of the twenty- first century", Journal of Raman Spectroscopy, vol. 37, no. 1-3, pp. 20-28, Jan. 2006 (doi: 10.1002/jrs.1486).
- [2] C. Gao, W. Lin, J. Wang, R. Wang, J. Wang, "Principle and application of tip-enhanced raman scattering", Plasmonics, vol. 13, pp. 1343-1358, 2018 (doi: 10.1007/s11468-017-0638-6).
- [3] F. Shao, R. Zenobi, "Tip-enhanced raman spectroscopy: Principles, practice, and applications to nanospectroscopic imaging of 2D materials", Analytical and Bioanalytical Chemistry, vol. 411, pp. 37–61, 2019 (doi: 10.1007/s00216-018-1392-0).
- [4] Z. Shen, X. Zi, M. Du, L. Zhang, Y. Shen, M. Hu, "Virtual probe stimulated tip-enhanced raman spectroscopy: The extreme field enhancement in virtual-real probe dimer", Journal of Applied Physics, vol. 129, Article Number: 133104, April 2021 (doi: 10.1063/5.0046647).
- [5] N. Mauser, A. Hartschuh, "Tip-enhanced near-field optical microscopy", Chemical Society Reviews, vol. 43, pp. 1248-1262, Feb. 2014 (doi: 10.1039/C3CS60258C).
- [6] R. Petry, N.C. Oliveira, A.C. Alves, A.G.S. Filho, D.S.T. Martinez, G. Hwang, F.A. Sousa, A.J. Paula, "Chapter 2- Nanomaterials properties of environmental interest and how to assess them", Advanced Nanomaterials, pp. 45-105, 2019 (doi: 10.1016/B978-0-12-814829-7.00002-1).
- [7] N. Kumar, S. Mignuzzi, W. Su, D. Roy, "Tip enhanced Raman spectroscopy: principles and applications", EPJ Techniques and Instrumentation, vol. 2, Article Number: 9, July 2015 (doi: 10.1140/epjti/s40485-015-0019-5).
- [8] N. Kazemi-Zanjani, S. Vedraine, F. Lagugné-Labarthet, "Localized enhancement of electric field in tip enhanced raman spectroscopy using radially and linearly polarized light", Optics Express, vol. 21, no. 21, pp. 25271–25276, Oct. 2013 (doi: 10.1364/OE.21.025271).
- [9] S. Najjar, D. Talaga, L. Schue, Y. Coffinier, S. Szunerits, R. Boukherroub, L. Servant, V. Rodriguez, S. Bonhommeau, "Tip-enhanced raman spectroscopy of combed double-stranded DNA bundles", The Journal of Physical Chemistry C, vol. 118, no. 2, pp. 1174–1181, 2014 (doi: 10.1021/jp410963z).
- [10] X. Wang, D. Zhang, K. Braun, H. J. Egelhaaf, C.J. Brabec, A.J. Meixner, "High-resolution spectroscopic mapping of the chemical contrast from nanometer domains in P3HT: PCBM organic blend films for solar-cell applications", Advanced Functional Materials, vol. 20, no. 3, pp. 492–499, Feb. 2010 (doi: 10.1002/adfm.20-0901930).
- [11] N. Lee, R. D. Hartschuh, D. Mehtani, A. Kisliuk, J.F. Maguire, M. Green, M.D. Foster, A.P. Sokolov, "High contrast scanning nano-Raman spectroscopy of silicon", Journal of Raman Spectroscopy, vol. 38, no. 6, pp. 789–796, June 2007 (doi: 10.1002/jrs.1698).

- [12] Y. Okuno, Y. Saito, S. Kawata, P. Verma, "Tip-enhanced Raman investigation of extremely localized semiconductor-to-metal transition of a carbon nanotube", Physical Review Letters, vol. 111, no. 21, Article Number: 216101, Nov. 2013 (doi: 10.1103/PhysRevLett.111.216101).
- [13] W. Su, D. Roy, "Visualizing graphene edges using tip-enhanced Raman spectroscopy", Journal of Vacuum Science and Technology B, vol. 31, Article Number: 041808, July 2013 (doi: 10.1116/1.4813848).
- [14] R. Zhang, Y. Zhang, Z.C. Dong, S. Jiang, C. Zhang, L.G. Chen, L. Zhang, Y. Liao, J. Aizpurua, Y. Luo, J.L. Yang, J.G. Hou, "Chemical mapping of a single molecule by Plasmon-enhanced Raman scattering", Nature, vol. 498, pp. 82–86, June 2013 (doi: 10.1038/nature12151).
- [15] B. Huang, M. Bates, X.W. Zhuang, "Super-resolution fluorescence microscopy", Annual Review of Biochemistry, vol. 78, pp. 993–1016, 2009 (doi: 10.1146/annurev.biochem.77.061906.092014).
- [16] N. Kumar, B.M. Weckhuysen, A.J. Wain, A.J. Pollard, "Nanoscale chemical imaging using tip-enhanced Raman spectroscopy", Nature Protocols, vol. 14, pp. 1169–1193, 2019 (doi: 0.1038/s41596-019-0132-z).
- [17] D. Kim, C. Lee, B.G. Jeong, S.H. Kim, M.S. Jeong, "Fabrication of highly uniform nanoprobe via the automated process for tip-enhanced Raman spectroscopy", Nanophotonics, vol. 9, no. 9, pp. 2989-2996, 2020 (doi: 10.1515/nanoph-2020-0210).
- [18] F. Lu, W. Zhang, J. Zhang, M. Liu, L. Zhang, T. Xue, C. Meng, F. Gao, T. Mei, J. Zhao, "Grating-assisted coupling enhancing plasmonic tip nanofocusing illuminated via radial vector beam", Nanophotonics, vol. 8, no. 12, pp. 2303–2311, 2019 (doi: 10.1515/nanoph-2019-0329).
- [19] Z. Yang, J. Aizpurua, X. Hongxing, "Electromagnetic field enhancement in TERS configurations", Journal of Raman Spectroscopy, vol. 40, pp. 1343–1348, 2009 (doi: 10.1002/jrs.2429).
- [20] L.Y. Meng, T.X. Huang, X. Wang, S. Chen, Z.L. Yang, B. Ren, "Gold-coated AFM tips for tip enhanced Raman spectroscopy: Theoretical calculation and experimental demonstration", Optics Express, vol. 23, no. 11, pp. 13804–13813, 2015 (doi: 10.1364/OE.23.013804).
- [21] S. Bruzzone, M. Malvaldi, G.P. Arrighini, C. Guidotti, "Theoretical study of electromagnetic scattering by metal nanoparticles", The Journal of Physical Chemistry B, vol. 109, 9, pp. 3807-3812, 2005 (doi: 10.1021-/jp045451a).
- [22] K.S. Kunz, R.J. Luebbers, "The finite difference time domain method for method for electromagnetics", CRC Press, 1993 (ISBN: 9780367402372).
- [23] K. Yee, "Numerical solution of initial boundary value problems involving Maxwell's equations in isotropic media", IEEE Trans. on antennas and propagation, vol. 14, no. 3, pp. 302-307, May 1966 (doi: 10.1109/T-AP.1966. 1138693).
- [24] D.M. Sullivan, "Electromagnetic simulation using the FDTD method", 2th Edition, John Wiley and Son, 2013 (doi: 10.1002/9781118646700).
- [25] F. Monsefi, M. Otterskog, S. Silvestrov, "Direct and inverse computational methods for electromagnetic scattering in biological diagnostics", arXiv Preprint arXiv, vol. 1312, Article Number: 4379, 2013.
- [26] P.B. Johnson, R.W. Christy, "Optical constants of the noble metals", Physical Review B, vol. 6, pp. 4370-4379, 1972 (doi: 10.1103/PhysRevB.6.4370).
- [27] Q. Zhan, "Cylindrical vector beams: from mathematical concepts to applications", Advances in Optics and Photonics, vol. 1, no. 1, 2009 (doi: 10.1364/AOP.1.000001).
- [28] B. Richards, E. Wolf, "Electromagnetic diffraction in optical systems. II. Structure of the image field in an aplanatic system", Proceedings of the Royal Society A : Mathematical Physical, vol. 253, pp. 358–379, 1959 (doi: 10.1098/rspa.1959.0200).
- [29] K. Youngworth, T. Brown, "Focusing of high numerical aperture cylindrical-vector beams", Optics express, vol. 7, pp. 77–87, 2000 (doi: 10.1364/oe.7.000077).
- [30] M. M. Sartin, H. Su, X. Wang, B. Rena, "Tip-enhanced Raman spectroscopy for nanoscale probing of dynamic chemical systems", The Journal of Chemical Physics, vol. 153, Article Number: 170901, 2020 (doi: 10.1063/5.0027917).

- 2. Scanning probe microscopy
- 3. Tip enhanced Raman spectroscopy
- 4. Localized surface plasmon resonance
- 5. Lighting rod
- 6. Gap-mode
- 7. Label-free
- 8. Three-dimensional finite difference time domain

زيرنويسها

- 9- Cone angles 10. Tip radiuses
- 11. Linearly and radially polarization
- 12. Substrate
- 13. Total field scattered field
- 14. Perfectly match layer
- 15. Nonuniform
- 16. Richards-wolf

^{1.} Atomic force microscopy